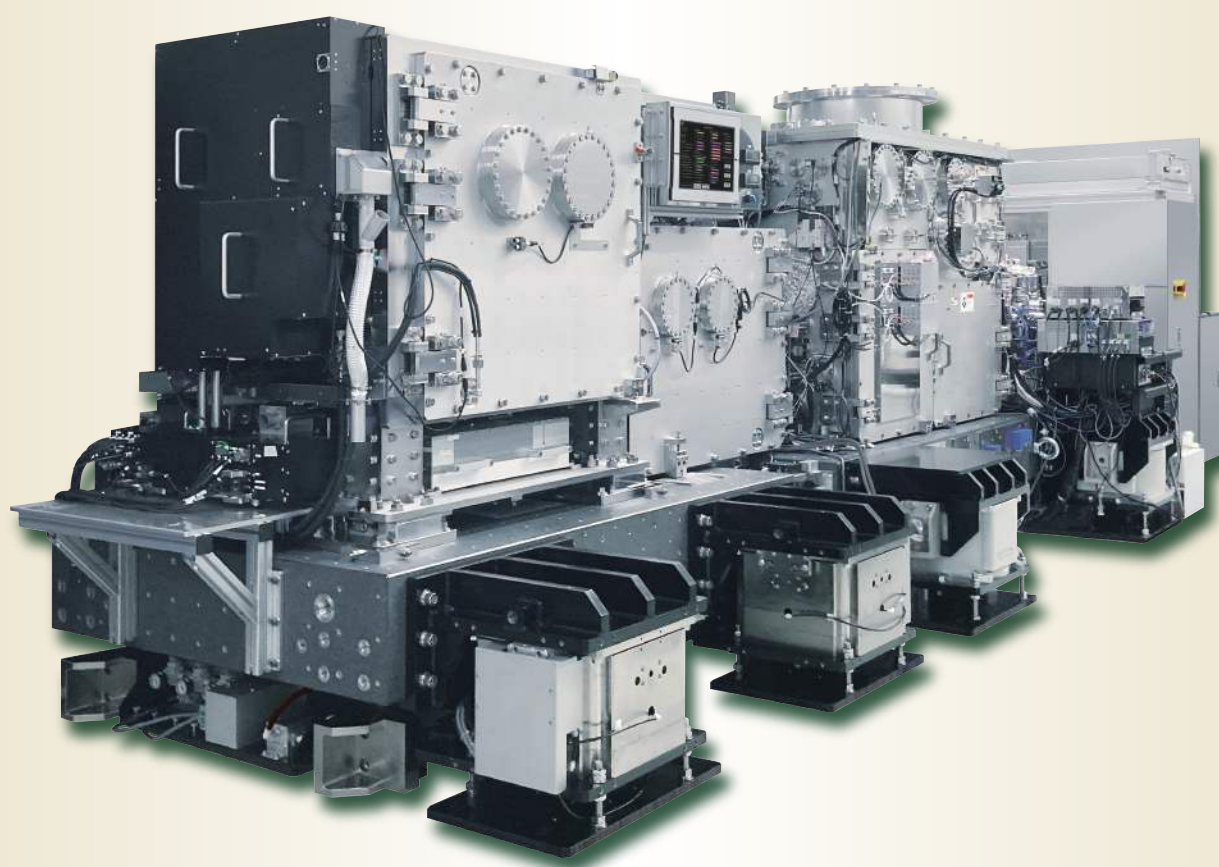


レーザー学会産業賞「優秀賞」受賞



高輝度EUVプラズマ光源 URASHIMA

Lasertec レーザーテック株式会社



世界初のアクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置 ACTISシリーズに搭載

特長

- 高速回転する液体状のスズ（Sn）にレーザーを照射してEUV光を発生させるLPP（Laser Produced Plasma）方式を採用
- ACTISの光学系に最適化した設計により、ペリクルとマスクへのダメージなく高輝度かつ低消費エネルギーを実現
- 高速回転するるつぼによる遠心力、デブリフィルターなど複数のデブリ低減機能により、デブリフリーなシステムを実現
- Snの自動補充メカニズムおよびリサイクルシステムにより、Snの消費を抑えながら長期間の連続稼働が可能

